

設備ID	装置名	Equipment
NM-001	NMR (ECS-400)	NMR (ECS-400)
NM-002	LC-MS (Q-Exactive Plus)	LC-MS (Q-Exactive Plus)
NM-020	LC-MS (Orbitrap Exploris 480)	LC-MS (Orbitrap Exploris 480)
NM-003	ラマン顕微鏡 (inVia Reflex)	Raman microscope (inVia Reflex)
NM-004	共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡 (SP5)	Confocal laser scanning fluorescence microscope (SP5)
NM-005	液中原子間力顕微鏡 (NanoWizard 4 XP)	Atomic force microscope (AFM) in liquid (NanoWizard 4 XP)
NM-006	桌上走査型電子顕微鏡装置群 (TM4000PlusII, TM3000)	Tabletop scanning electron microscope (SEM) (TM4000PlusII, TM3000)
NM-007	表面プラズモン共鳴装置 (Biacore X100)	Surface plasmon resonance (SPR) instrument (Biacore X100)
NM-008	プレートリーダー (EnSight)	Plate reader (EnSight)
NM-009	分光光度計 (U-2900)	Spectrophotometer (U-2900)
NM-010	分光蛍光光度計 (F-7000)	Fluorescence spectrophotometer (F-7000)
NM-011	フーリエ変換赤外分光光度計 (IRTracer-100)	FT-IR (IRTracer-100)
NM-012	円二色性分散計 (J-725)	Circular dichroism (CD) (J-725)
NM-013	ゼータ電位計 (ELSZ-1000Z)	Zeta potential analyzer (ELSZ-1000Z)
NM-014	動的光散乱光度計 (DLS-8000HAL)	Dynamic light scattering (DLS) spectrophotometer (DLS-8000HAL)
NM-015	粒度分布測定装置 (SALD-2100)	Particle size analyzer (SALD-2100)
NM-016	接触角計 (VCA Optima-XE)	Contact angle meter (VCA Optima-XE)
NM-017	テクスチャーアナライザー (TA-XT2i)	Texture analyzer (TA-XT2i)
NM-018	HPLC (質量分析計付き) (Prominence LXQ)	HPLC with MS (Prominence LXQ)
NM-019	ゲル浸透クロマトグラフィー装置群 (Nexera40, DAWN 8, GPC-101)	Gel permeation chromatography (GPC) (Nexera40, DAWN 8, GPC-101)
NM-101	500MHz固体汎用NMRシステム (JNM-ECZ500R)	500 MHz Solid-State NMR (I) (JNM-ECZ500R)
NM-102	500MHz固体高分解能NMRシステム (JNM-ECZ500R)	500 MHz Solid-State NMR (II) (JNM-ECZ500R)
NM-103	800MHzナローボア固体高分解能NMRシステム (JNM-ECA800)	800 MHz Solid-State high-resolution NMR (JNM-ECA800)
NM-201	多環境場対応型X線単結晶構造解析装置 (XtaLAB Synergy-R/DW Custom)	Single Crystal X-ray Diffractometer for Multiple Environments (XtaLAB Synergy-R/DW Custom)
NM-209	2波長Pilatus低温単結晶X線回折装置_NSC (VariMax DW AFC11 with Pilatus)	sXRD_R_DW_LT_Pilatus_NSC (VariMax DW AFC11 with Pilatus)
NM-204	多目的X線回折装置_Cu_SSL (SmartLab 9 kW)	pXRD_Multi_Cu_R_SSL (SmartLab 9 kW)
NM-210	温度可変型粉末X線回折装置_Cu1_NTS (SmartLab 9 kW with cryostat/furnace)	pXRD_LT/HT_Cu1_R_NTS (SmartLab 9 kW with cryostat/furnace)
NM-211	高速・高感度型粉末X線回折装置_Cu_ASC_NS3 (SmartLab3)	pXRD_Cu_ASC_NS3 (SmartLab3)
NM-212	卓上型粉末回折計_Cu_ASC_NC1 (MiniFlex600_Cu)	pXRD_Cu_ASC_NC1 (MiniFlex600_Cu)
NM-213	卓上型粉末回折計_Cu_ASC_NC2 (MiniFlex600_Cu)	pXRD_Cu_ASC_NC2 (MiniFlex600_Cu)
NM-214	卓上型粉末回折計_Cr_SCR (MiniFlex600_Cr)	pXRD_Cr_SCR (MiniFlex600_Cr)
NM-215	卓上型X線回折計_Cu_SMF (MiniFlex600_Cu)	pXRD_Cu_SMF (MiniFlex600_Cu)
NM-216	薄膜X線回折装置_Cu (SmartLab)	TF-XRD_Cu (SmartLab)
NM-228	微小部蛍光X線分析装置 (ORBIS PC)	Micro Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer (Micro-EDXRF)
NM-202	硬X線光電子分光分析装置 (HAX-PES/XPS) (Quantes)	Dual Scanning X-ray Photoelectron Microprobe Equipped with Hard X-Ray (HAX-PES/XPS) (Quantes)
NM-225	X線光電子分光分析装置 (XPS-Quantera SXM)	XPS (Quantera SXM)
NM-203	誘導結合プラズマ発光分析装置群 (1. 720 ICP-OES 2. Agilent5800 3. Agilent7850 4. SPS3520DD-UV 5. Element XR 6. Agilent5800)	Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometers / Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometers (1. 720 ICP-OES 2. Agilent5800 3. Agilent7850 4. SPS3520DD-UV 5. Element XR 6. Agilent5800)
NM-230	マルチガス導入グロー放電質量分析システム (VG9000)	Glow Discharge Mass Spectrometer (GD-MS)
NM-205	飛行時間型二次イオン質量分析装置 (PHI TRIFT V nanoTOF)	Time-of-flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS) (PHI TRIFT V nanoTOF)
NM-229	イオンクロマトグラフシステム	Ion chromatograph
NM-206	酸素窒素水素分析装置 (ONH836)、炭素硫黄分析装置 (CS844)	Oxygen/Nitrogen/Hydrogen Analyzer (ONH836), Carbon/Sulfur Analyzer (CS844)
NM-217	熱分析装置 (TG/DTA + DSC) (TG/DTA 6200, X-DSC7000)	TG/DTA + DSC (TG/DTA 6200, X-DSC7000)
NM-218	ゼータ電位 & 粒径測定装置 (ELSZ-2000ZS)	Zeta-potential/Particle-size analyzer (ELSZ-2000ZS)
NM-219	フーリエ変換赤外分光光度計 (IRAffinity-1S)	FT-IR (IRAffinity-1s)
NM-220	紫外可視近赤外分光計 (V-770)	UV-Vis-NIR (V-770)
NM-221	分光蛍光光度計 (FP-8500DS)	Spectrofluorometer (FP-8500DS)
NM-222	蛍光分光計 (Fluorolog-3)	Spectrofluorometer (Fluorolog-3)
NM-223	フーリエ変換赤外分光計 (FT/IR-6700)	Fourier transform infrared spectrometer (FT/IR-6700)
NM-224	中低温示差熱分析装置 (DSC200F3)	Medium- and low-temperature differential thermal analyzer (DSC200F3)
NM-207	電界放出形電子線プローブマイクロアナライザー装置 (JXA-8500F)	Field Emission Electron Probe Micro-Analyzer (FE-EPMA) (JXA-8500F)
NM-208	走査型オージェ電子分光分析装置 (JAMP-9500F)	Scanning Auger Electron Microprobe (CHA Type AES) (JAMP-9500F)
NM-226	ショットキー電界放出型走査電子顕微鏡 (JSM-7001F)	Schottky FE-SEM (JSM-7001F)
NM-227	電界放出形走査電子顕微鏡 (SU8000)	FE-SEM (SU-8000)
NM-231	電界放出形走査電子顕微鏡 (JSM-6500F)	Field Emission Scanning Electron Microscope (JSM-6500F)
NM-232	走査電子顕微鏡 (JSM-6510)	Scanning Electron Microscope (JSM-6510)
NM-403	TEM試料自動作製FIB-SEM複合装置 (NX5000)	FIB-SEM combined apparatus for automatic preparation of TEM specimens (NX5000)
NM-404	無損傷電子顕微鏡試料薄片化装置 (Model 1040 Nanomill)	Damage-less TEM specimen milling apparatus (Model 1040 Nanomill)
NM-407	セラミックス試料作製装置群	Ceramics sample preparation facilities
NM-501	実動環境対応物理分析電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-G)	Real working environment physical characterization TEM (JEM-ARM200F-G)
NM-502	実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡 (JEM-ARM200F-B)	Real working environmental electron holography microscope (JEM-ARM200F-B)
NM-503	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F1)	200kV field emission transmission electron microscope (JEM-2100F1)
NM-504	200kV電界放出形透過電子顕微鏡 (JEM-2100F2)	200kV field emission transmission electron microscope (JEM-2100F2)
NM-505	200kV透過電子顕微鏡 (JEM-2100)	200kV transmission electron microscope (JEM-2100)
NM-506	2軸傾斜パイアス印加・加熱TEM試料ホルダー (Lightning)	Double-tilt bias and heating TEM holder (Lightning)
NM-507	2軸傾斜液体窒素冷却TEM試料ホルダー (Gatan 636)	Double-tilt LN2 cryo TEM holder (Gatan 636)

設備ID	装置名	Equipment
NM-508	走査型電子顕微鏡 (JSM-7000F)	Field emission scanning electron microscope (JSM-7000F)
NM-302	微細組織3次元マルチスケール解析装置 (SMF-1000)	Orthogonal FIB-SEM(SMF-1000)
NM-517	FIB/SEM精密微細加工装置 (Helios 650)	FIB/SEM microfabrication instrument(Helios 650)
NM-509	デュアルビーム加工観察装置 (NB5000)	Dual Beam system (NB5000)
NM-510	FIB加工装置 (JIB-4000)	Focused Ion Beam system (JIB-4000)
NM-511	FIB加工装置 (JEM-9320FIB)	Focused Ion Beam system (JEM-9320FIB)
NM-512	FIB加工装置 (JEM-9310FIB)	Focused Ion Beam system (JEM-9310FIB)
NM-513	ピックアップシステム	Pick-up System
NM-514	ウルトラミクロトーム (Leica EM UC6)	Ultramicrotome (Leica EM UC6)
NM-515	電子線トモグラフィ解析システム	Electron tomography analysis system
NM-516	TEM試料作製装置群	TEM sample preparation apparatus
NM-661	電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS]	EB Lithography [JBX-8100FS]
NM-601	電子ビーム描画装置 [ELS-F125]	EB Lithography [ELS-F125]
NM-635	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	EB Lithography [ELS-BODEN100]
NM-603	レーザー描画装置 [DWL66+]	Laser Lithography [DWL66+]
NM-636	マスクレス露光装置 [DL-1000]	Maskless Lithography [DL-1000]
NM-604	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	Maskless Lithography [DL-1000/NC2P]
NM-660	マスクレス露光装置 [MLA150]	Maskless Lithography [MLA150]
NM-637	マスクアライナー [MA-6]	Mask Aligner [MA-6]
NM-605	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	H2O Plasma Cleaner [AQ-500 #1]
NM-638	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	H2O Plasma Cleaner [AQ-500 #2]
NM-606	UVオゾンクリーナー [UV-1]	UV Ozone Cleaner [UV-1]
NM-608	スパッタ装置 [JSP-8000]	Sputter [JSP-8000]
NM-641	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	Sputter [CFS-4EP-LL #2]
NM-607	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	Sputter [CFS-4EP-LL #3]
NM-664	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #4]	Sputter [CFS-4EP-LL #4]
NM-610	電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	EB Evaporator [RDEB-1206K]
NM-609	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	EB Evaporator [ADS-E86]
NM-642	電子銃型蒸着装置 [MB-501010]	EB Evaporator [MB-501010]
NM-665	電子銃型蒸着装置 [ADS-E810]	EB Evaporator [ADS-E810]
NM-644	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	ALD [SUNALE R-150]
NM-611	原子層堆積装置 [AD-230LP]	ALD [AD-230LP]
NM-633	SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL]	SiO2 PECVD [PD-220NL]
NM-612	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	SiN PECVD [PD-220NL]
NM-613	リフトオフ装置 [KLO-150CBU]	Auto Lift-Off [KLO-150CBU]
NM-614	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	CCP-RIE [RIE-200NL]
NM-615	ICP-RIE装置 [RIE-101iPH]	ICP-RIE [RIE-101iPH]
NM-617	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	ICP-RIE [RV-APS-SE]
NM-645	ICP-RIE装置 [CE300I]	ICP-RIE [CE300I]
NM-616	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	Si Deep RIE [ASE-SRE]
NM-618	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	ALE [PlasmaPro 100 ALE]
NM-662	低ダメージ精密エッチング装置 [Spica]	ICP-RIE [Spica]
NM-646	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #1]	RTA [RTP-6 #1]
NM-619	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	RTA [RTP-6 #2]
NM-634	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	RTA [RTP-6 #3]
NM-621	FE-SEM [S-4800]	FE-SEM [S-4800]
NM-647	FE-SEM+EDX [S-4800]	FE-SEM+EDX [S-4800]
NM-648	FE-SEM+EDX [SU8000]	FE-SEM+EDX [SU8000]
NM-649	FE-SEM+EDX [SU8230]	FE-SEM+EDX [SU8230]
NM-650	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	Tabletop SEM+EDX [TM3000]
NM-622	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	SPM [Jupiter XR]
NM-651	走査型プローブ顕微鏡 [L-trace]	SPM [L-trace]
NM-652	走査型プローブ顕微鏡 [Nanoscope5]	SPM [Nanoscope5]
NM-623	レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000]	Laser Microscope [LEXT OLS4000]
NM-653	レーザー顕微鏡 [VK-9700]	Laser Microscope [VK-9700]
NM-626	触針式プロファイラー [Dektak XT-A]	Surface Profilometer [Dektak XT-A]
NM-654	触針式プロファイラー [Dektak 6M]	Surface Profilometer [Dektak 6M]
NM-625	エリプソメーター [MARY-102FM]	Ellipsometer [MARY-102FM]
NM-655	分光エリプソメーター [M2000]	Spectroscopic Ellipsometer [M2000]
NM-663	分光エリプソメーター [UNECS-2000A]	Spectroscopic Ellipsometer [UNECS-2000A]
NM-624	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	Optical Film Mapper [F54-XY-200-UV]
NM-628	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	Thin-Film Stress Tester [FLX-2000-A]
NM-629	ダイシングソー [DAD322]	Dicing Saw [DAD322]
NM-656	ダイシングソー [DAD3220]	Dicing Saw [DAD3220]
NM-630	室温プローバー [MX-200/B]	Room Temp. Prober [MX-200/B]
NM-657	室温プローバー [HMP-400]	Room Temp. Prober [HMP-400]
NM-658	低温プローバー [GRAIL-408-32-B]	Low Temp. Prober [GRAIL-408-32-B]
NM-631	液体窒素プローバー [SB-LN2]	Liquid N2 Prober [SB-LN2]
NM-659	ワイヤーボンダー [7476D #1]	Wire Bonder [7476D #1]
NM-632	ワイヤーボンダー [7476D #2]	Wire Bonder [7476D #2]